Searching PAJ 1/1 ページ

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000-137327 (43)Date of publication of application: 16.05,2000

(51)Int.Cl. G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 11-238542 (71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing: 25.08.1999 (72)Inventor: FUJISHIMA HIROAKI

KAMIYA YASUNORI ARAKI KO

ARAKI KU

(30)Priority

Priority number: 10240143 Priority date: 26.08.1998 Priority country: JP

### (54) CHEMICALLY AMPLIFIED POSITIVE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photoresist composition good in sensitivity and resolution and especially high in adhesion to substrate by incorporating a resin having 2 kinds of specified polymerization units and an acid senerator.

SOLUTION: The photoresist composition contains the polymer having polymerization units each represented by the formula derived from a monomer of 2-alkyl-2-adamantyl (meth)acrylate and further polymerization units selected from 3-hydroxy-1-adamantyl (meth)acrylate and (meth) acrylonitrile monomers, and the acid generator. In the formula, R1 is H atom or methyl group; and R2 is an alkyl group. This resin is a copolymer of a 30-80 mol% 2-alkyl-2-adamantyl (meth)acrylate monomer and 20-70 mol% monomer selected from 3-hydroxy-1-adamantyl (meth)acrylate and (meth)acrylonitrile monomers.



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-137327 (P2000-137327A)

(43)公開日 平成12年5月16日(2000.5.16)

(51) Int.Cl.7 截別記号 FΙ テーマコード(参考) G 0 3 F 7/039 G03F 7/039 601 601 H01L 21/027 H 0 1 L 21/30 502R

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特顧平11-238542	(71)出願人	000002093
			住友化学工業株式会社
(22)出顧日	平成11年8月25日(1999.8.25)		大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者	藤島 浩晃
(31)優先権主張番号	特願平10-240143		大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
(32)優先日	平成10年8月26日(1998.8.26)		友化学工業株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	上谷 保則
			大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
			友化学工業株式会社内
		(72)発明者	荒木 香
			大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
			友化学工業株式会社内
		(74)代理人	100093285
			弁理士 久保山 隆 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】 化学増幅型ポジ型レジスト組成物

#### (57) 【要約】

【課題】 感度や解像度などの各種レジスト性能が良好 であるとともに、基板への接着性に優れる化学増幅型の ポジ型レジスト組成物を提供する。

【解決手段】 樹脂成分と酸発生剤を含有する化学増幅 型ポジ型レジスト組成物であって、その樹脂成分が、 (メタ) アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルの 重合単位を有し、さらに(メタ)アクリル酸3-ヒドロ キシー1-アダマンチルの重合単位(II)及び/又は (メタ) アクリロニトリルの重合単位(III) を有する組 チロラクトンの重合単位(IV)及び/又は無水マレイン 酸の重合単位(V)を有する組成物が提供され、また別 に、当該樹脂成分が、メタクリル酸2-エチル-2-ア ダマンチルの重合単位を有し、さらに(II)~(V)の 一又は複数を有する組成物も提供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下式(1)



(式中、R<sup>1</sup> は水蒸又はメチルを表し、R<sup>2</sup> はアルキルを表す)で示される電合単位を有し、さらに(メタン アクリル機の - ヒドロキシ - 1 ー アダマンチル及び(メ タ)アクリロニトリルから選ばれるモノマーの蛋合単位 を有する階層、並びに腹発生剤を含有することを特徴と する化学物理型単ジア レジス・組成物。

【請求項2】 旅報節が、(メタ)アクリル酸2-アルキルー2-アダマンチルを30-80モルを遊びに、(メタ)アクリル酸3-ドロキシー 1 ーアダマンチル及び(メタ)アクリカロートリルから遊ばれるモノマーを20 20~7 0モル%含むモノマー混合物の共蛋合により得られる請求項 訂認め 現成物。

【請求項3】該樹脂が、さらにα-メタクリロイロキシ - y-ブチロラクトン及び無水マレイン酸から選ばれる モノマーの重合単位を有する請求項1記載の組成物。

【請求項4】該機能が、(メタ)アクリル酸2ーアルキル-2ーアダマンチルを30~80モル%並びに、(メタ)アクリル酸3ーとドロキシー1ーアダマンチル及び(メタ)アクリロニトリルから選ばれる第一のモノマー及びa-メタリロイロキシー アーブチロラクトン及び9無水マレイン酸から選ばれる第二のモノマーを合計で20~70モル%含むモノマー混合物の共進合により得られる請求項る証拠の組成物。

【請求項5】該樹脂が、式(1)で示される重合単位、 (メタ)アクリル穢3ーヒドロキシー1ーアダマンチル の重合単位及び $\alpha$ ーメタクリロイロキシー $\gamma$ ープチロラ クトンの重合単位を有する請求項3又は4記載の組成 物。

【請求項6】 $R^1$  がメチルであり、 $R^2$  がエチルである 請求項1~5のいずれかに記載の組成物。

【請求項7】 (メタ) アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルが、メタクリル酸3-ヒドロキシ-1-ア ダマンチルである請求項1~6のいずれかに記載の組成 物。

【蘭東電引】メタクリル酸2-エチルー2-アダマンチルの蛋合単位を育し、さらに(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシー1-アダマンチル、(メタ)アクリロニトリル、α-メタクリロイロキシ- y-ブチロラクトン及び黒水マレイン酸から選ばれるモノマーの蛋合単位を有する機能、並びに機能生剤を含有することを特数とする化。

学増幅型ポジ型レジスト組成物。

【請求項9】 該機階が、メタクリル微2 ーエチルー2ー ゲダマンチルを30~80モル%並びに、(メタ)アク リル微3ーヒドロキシー1 ー ゲダマンチル、(メタ)ア クリロニトリル、α – メタクリロイロキシー γ ー ブチロ ラクトン及び無水マレイン般から選ばれるモノマーを2 の~70モル%含有するモノー。混合物の共運合により 得られる請求項を記載の組成物。

2

【請求項10】該樹脂が、メタクリル酸2-エチル-2 - アダマンチルの重合単位及び(メタ)アクリル酸3-ヒ ドロキシ-1-アダマンチルの重合単位を有する請求項 8又は9記載の組成物。

【請求項11】該樹脂が、メタクリル酸2-エチル-2 ーアダマンチルの重合単位及びα-メタクリロイロキシ - y ープチロラクトンの重合単位を有する請求項8又は 9記載の組成物。

【請求項12】該樹脂が、さらに (メタ) アクリル酸3 ーヒドロキシー1ーアダマンチルの重合単位を有する請 求項11記載の組成物。

【請求項13】該樹脂が、さらに式(I)



(式中、R<sup>1</sup> kt水素又はメチルを表し、R<sup>2</sup> ktアルキ ルを表す)で示される重合単位(ただし、メタクリル酸 2ーエチルー2ーアダマンチルの重合単位を除く)を有 する請求項8記載の組成物。

【請求項14】該樹脂が、メタクリル酸2-エチル-2 ーアダマンチルを20モル%以上で、かつそれを含む (メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルを 合計30~80モル%、並びに(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、(メタ)アクリロニト リル、α-メタクリロイロキシーy-アサロラトン及 び無水マレイン酸から選ばれるモノマーを20~70モ 40 ル%含有するモノマー混合物の共蛋合により得られる請 京項13星級の組成物。

【請求項15】 (メタ) アクリル酸3 ーヒドロキシー1 ーアダマンチルが、メタクリル酸3 ーヒドロキシー1 ーアダマンチルである請求項8、9、10、12、13又 は14 記載の組成物。

【請求項16】さらにアミン類をクェンチャーとして含 有する請求項1~15のいずれかに記載の組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】「発明の属する技術分野」本発明は、半導体の微細加工

に用いられる化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関す るものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体の微細加工には通常、レジスト組 成物を用いたリソグラフィプロセスが採用されており、 リソグラフィにおいては、レイリー (Rayleigh) の回折 限界の式で表されるように、原理的には露光波長が短い ほど解像度を上げることが可能である。半導体の製造に 用いられるリソグラフィ用露光光源は、波長436nmの g線、波長365nmのi線、波長248nmのKrFエキ 10 シマレーザーと、年々短波長になってきており、次世代 の露光光源として、波長193mmのArFエキシマレー ザーが有望視されている。

【0003】ArFエキシマレーザー露光機に用いられ るレンズは、従来の露光光源用のものに比べて寿命が短 いので、ArFエキシマレーザー光に曝される時間はで きるだけ短いことが望ましい。そのためには、レジスト の感度を高める必要があることから、露光により発生す る酸の触媒作用を利用し、その酸により解裂する基を有 られる。

【0004】ArFエキシマレーザー露光用のレジスト に用いる樹脂は、レジストの透過率を確保するために芳 香環を持たず、またドライエッチング耐性を持たせるた めに芳香環の代わりに脂環式環を有するものがよいこと が知られている。このような樹脂としてこれまでにも、 D.C. Hofer, Journal of Photopolymer Science and Tec hnology, Vol.9, No.3, 387-398 (1996) に記載される ような各種の樹脂が知られている。しかしながら、従来 公知の樹脂では、特にその極性が足りない場合に、現像 30 時の接着性不足から、現像剥がれを起こしやすいという 問題がある。

[0005] S. Takechi et al, Journal of Photopoly mer Science and Technology, Vol.9, No.3, 475-487 (1996) や特開平 9-73173号公報には、メタクリル酸2 - メチル-2-アダマンチルの重合体又は共重合体を化 学増幅型レジストの樹脂として用いた場合には、2-メ チルー2-アダマンチルが砂の作用により解裂してポジ 型に作用するとともに、高いドライエッチング耐性、高 解像性及び基板への良好な接着性が得られることが報告 40 されている。

#### [0006]

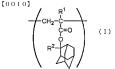
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、樹脂 成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrFなどのエキシ マレーザーリソグラフィに滴した化学増幅型のボジ型レ ジスト組成物であって、感度や解像度などの各種のレジ スト性能が良好であるとともに、特に基板への接着性に 優れるものを提供することにある。

【0007】本発明者らは先に、化学増幅型ポジ型レジ スト組成物を構成する樹脂として、重合単位の一部にブ 50 チロラクトン残基を有するものを用いることにより、あ るいは(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマン チルの重合単位及び無水マレイン酸の重合単位を有する ものを用いることにより、基板への接着性が改良される ことを見出し、それぞれ特願平 10-12406 号及び特願平 10-191559号として特許出願している。これらの知見を もとにさらに研究を重ねた結果、アダマンタン系の特定 構造の重合単位とともにある種の極性の高い重合単位を 有する樹脂が、基板への接着性の改良に有効であること を見出し、本発明を完成した。

# [0008]

【測題を解決するための手段】すなわち本発明は、(メ タ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルの重合 単位を有し、さらに(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ 1ーアダマンチル及び(メタ)アクリロニトリルから 選ばれるモノマーの重合単位を有する樹脂、並びに酸発 生剤を含有してなる化学増幅型ポジ型レジスト組成物を 提供するものである。

【0009】ここでいう(メタ)アクリル酸2-アルキ する樹脂を含有するいわゆる化学増幅型レジストが用い 20 ルー2-アダマンチルの重合単位とは、アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルマはメタクリル酸2-アル キル-2-アダマンチルにおける(メタ)アクリル酸部 分の二重結合が開いて形成される単位を意味し、(メ タ) アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重 合単位とは、アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマン チル又はメタクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチ ルにおける(メタ)アクリル酸部分の二重結合が開いて 形成される単位を意味し、また、 (メタ) アクリロニト リルの重合単位とは、アクリロニトリル又はメタクリロ ニトリルの二重結合が開いて形成される単位を意味し、 それぞれ次式(I)~(III)で示されるものである。



【0011】式中、R1 は水素又はメチルを表し、R2 はアルキルを表す。

[0012]



【0013】式中、R3 は水素又はメチルを表す。 【0014】

[0015]式中、R\* は水素又はメチルを表す。
[0016]したがってこの樹脂は、上記式(1)の単位とともに、上記式(11)の単位とともに、上記式(11)の単位のうち一方又は双方を必須に有するものである。この樹脂はほた、他の単位、例えば、αーメタクリロイローシーソープチロラクトンの重合単位を無水マレイン酸の重合単位を有してもよい。ここでいうαーメタクリロイロキシーソープチロラクトンにおけるメタクリル機部分の二重結合が開いて形成される単位を意味し、無水マレイン酸の重合単位とは、無水マレイン酸の二重結合が開いて形成される単位を意味し、無水マレイン酸の二重結合が開いて形成される単位を意味し、

[0.017]

[0018]式(1)で示される(メタ)アクリル酸2 ーアルキルー2ーアダマンチルの重合単位のなかでも、 R! がメチルであり、そしてR? がエチルであるもの、 すなわち下式(Ia)で示されるメタクリル酸2ーエチル ー2ーアダマンチルの重合単位は重要である。 [0018]

$$\begin{array}{c|c} & CH_3 \\ \hline CH_2-C \\ \hline C=O \\ O \\ C_2H_5 \\ \end{array} \qquad ( \text{ [ a)}$$

【0020】この重合単位は、前記式(II)で示される 10 (メタ) アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル の重合単位、前記式(III) で示される (メタ) アクリロ ニトリルの重合単位、前記式(IV)で示されるα-メタ クリロイロキシー y ープチロラクトンの重合単位、及び 前記式(V)で示される無水マレイン酸の重合単位の少 なくとも一つと組み合わせて用いられうる。そこで本発 明はまた、メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル の重合単位を有し、さらに (メタ) アクリル酸3-ヒド ロキシー1-アダマンチル、(メタ)アクリロニトリ ル、α-メタクリロイロキシ-v-ブチロラクトン及び 無水マレイン酸から選ばれるモノマーの重合単位を有す る樹脂、並びに酸発生剤を含有してなる化学増幅型ポジ 型レジスト組成物をも提供する。この樹脂はしたがっ て、上記式 (Ia) の単位とともに、前記式 (II) の単 位、前記式(III) の単位、前記式(IV) の単位及び前記 式(V)の単位のうち一又は複数を必須に有するもので ある.

#### [0021]

【発卵の実施の形態】未発明において第一の見地から特定する影解は、前記式(I)で示される(メタ)アクリ

ル酸2―アルキルー2―アダマンチルの蛋合単位を有し、さらに、前記式(II)で示される(メタ)アクリル酸コードロキシー1―アダマンチルの蛋合単位及び前記式(III)で示される(メタ)アクリロニトリルの蛋合単位のうち、一方又は双方を有するものである。また任意に、前記式(IV)で示されるαーメタクリロイロキシーソープチロラクトンの重合単位及び/父は前記式

(V) で示される無水マレイン酸の重合率位を作することもできる。したがってこの樹脂は、(メタ) アクリル酸 2 一アルキルー2 ーアダマンチルを一つのモノマーとし、ざらに、(メタ) アクリル酸 3 一ドロキシー1 アダマンチル及び/又は(メタ) アクリロニトリルを別のモノマーとして、必要により a メタクリロイロキシー y ーブチロラクトン及び/又は無水マレイン酸をさらに別のモノマーとして、共重合を行うことにより製造できる。

【0022】これらのモノマーのうち、(メタ)アクリル酸2-アルキルー2-アダマンチルは通常、2-アルキルー2-アダマンタノール又はその企麻量とアクリル酸ハライド又はメタクリル酸ハライドとの反応により製 遊できる。また(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシー1

- アダマンチルは、1、3 - ジブロモアダマンタンを加 水分解して1.3-ジヒドロキシアダマンタンとし、こ れをアクリル酸、メタクリル酸又はそれらのハライドと 反応させることにより製造できる。

【0023】式(I)で示される(メタ)アクリル酸2 アルキルー2-アダマンチルの重合単位は、脂環式環 であるアダマンタン環の存在により、レジストの透過率 を確保し、またドライエッチング耐性の向上に寄与す る。さらにこの単位中の2-アルキル-2-アダマンチ ルは、酸の作用により解裂するので、この単位は、レジ 10 スト膜の露光後のアルカリ溶解性を高めるのに寄与す る。式(I) 中のR<sup>2</sup> はアルキルであり、このアルキル は例えば、炭素数1~8程度であることができ、通常は 直鎖であるのが有利であるが、炭素数3以上の場合は分 岐していてもよい。具体的なR2 としては、メチル、エ チル、nープロピル、イソプロピル、nープチルなどが 挙げられる。なかでも、R2 がメチル又はエチル、とり わけエチルであるものは、レジストと基板との接着性や 解像庫の向上にとって好都合である。式(I)中、R1 がメチルで R2 がエチルである場合、それを含むレジス 20 トは、基板に対する特に高い接着性を示す。

【0024】そこで本発明において第二の見地から特定 する樹脂は、前記式(Ia)で示されるメタクリル酸2-エチルー2-アダマンチルの重合単位を有し、 さらに 前記式(II)で示される(メタ)アクリル酸3-ヒドロ キシ-1-アダマンチルの重合単位、前記式(III) で示 される (メタ) アクリロニトリルの重合単位、前記式 (IV) で示されるα-メタクリロイロキシ-y-ブチロ ラクトンの重合単位及び前記式(V)で示される無水マ レイン酸の重合単位のうち、一又は二以上を有するもの 30 である。したがってこの樹脂は、メタクリル酸2-エチ ルー2-アダマンチルを一つのモノマーとし、さらに (メタ) アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチ ル、(メタ) アクリロニトリル、α-メタクリロイロキ シー y - ブチロラクトン及び無水マレイン酸の一叉は二 以上を別のモノマーとして、共重合を行うことにより製 造できる。

-エチルー2-アダマンチルは、2-エチルー2-アダ マンタノール又はその金属塩とメタクリル酸ハライドと の反応により製造できる。例えば、2-アダマンタノン にエチルリチウムを作用させると、リチウム 2-エチ ルー2-アダマンタノラートが生成するので、これをメ タクリル酸ハライドと縮合させることにより、メタクリ ル酸2-エチル-2-アダマンチルが得られる。 【0026】式(II) で示される (メタ) アクリル酸3 -ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、式(III) で示される(メタ)アクリロニトリルの重合単位、式

(IV) で示されるα-メタクリロイロキシ-y-プチロ

【0025】これらのモノマーのうち、メタクリル酸2

レイン酸の重合単位は、いずれも極性が高く、それらの いずれかを樹脂中に存在させることにより、それを含む レジストの基板への接着性向上に寄与する。なかでも、 α-メタクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単 位は接着性向上効果に優れ、式(Ia)で示されるメタク リル酸2-エチル-2-アダマンチルの重合単位との組 合せにおいて、その効果が顕著であり、また式(1)で 示される (メタ) アクリル酸2-アルキル-2-アダマ ンチルの重合単位の場合であっても、(メタ)アクリル 酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位又は (メタ) アクリロニトリルの重合単位との組合せにおい て、その効果が顕著である。さらに、上記各単位のう ち、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマン チルの重合単位、(メタ) アクリロニトリルの重合単位 及び無水マレイン酸の重合単位は、レジストのドライエ ッチング耐性の向上にも寄与し、(メタ)アクリル酸3 ヒドロキシー1-アダマンチルの重合単位及びα-メ

【0027】 化学増幅型ボジ型レジスト用の樹脂は一般 に、それ自体ではアルカリに不溶ないし難溶であるが、 酸の作用により一部の基が解裂し、解裂後はアルカリ可 溶性となるものであり、本発明において特定する樹脂で は、前記式(1)中の2-アルキル-2-アダマンチル 又は前記式(Ia)中の2-エチル-2-アダマンチルが 酸の作用により解裂する。したがって、式(1)又は式 (Ia) の重合単位を有することにより、この樹脂を含む レジスト組成物はポジ型に作用するが、必要に応じて、 酸の作用により解裂する基を有する他の重合単位を含ん でもよい。

タクリロイロキシー y - プチロラクトンの重合単位は、

レジストの解像性の向上にも寄与する。

【0028】酸の作用により解裂する他の基として、具 体的には、カルボン酸の各種エステル、例えば、tert-ブチルエステルに代表されるアルキルエステル、メトキ シメチルエステル、エトキシメチルエステル、1-エト キシエチルエステル、1-イソプトキシエチルエステ ル、1-イソプロポキシエチルエステル、1-エトキシ プロピルエステル、1-(2-メトキシエトキシ)エチ ルエステル、1-(2-アセトキシエトキシ)エチルエ ステル、1-「2-(1-アダマンチルオキシ)エトキ シ〕エチルエステル、1-「2-(1-アダマンタンカ ルボニルオキシ)エトキシ〕エチルエステル、テトラヒ ドロー2-フリルエステル及びテトラヒドロー2-ピラ ニルエステルのようなアヤタール型エステル。イソボル ニルエステルのような脂環式エステルなどが挙げられ る。このようなカルボン酸エステルを有する重合単位へ 導くモノマーは、メタクリル酸エステルやアクリル酸エ ステルのようなアクリル系のものでもよいし、ノルボル ネンカルボン酸エステル、トリシクロデセンカルボン酸 エステル、テトラシクロデセンカルボン酸エステルのよ ラクトンの重合単位、 及び式 (V) で示される無水マ 50 うに、カルボン酸エステル基が脂環式モノマーに結合し

たものでもよい.

【0029】本発明で用いる樹脂は、パターニング露光 用の放射線の種類や酸の作用により解裂する基の種類な どによっても変動するが、一般には、酸の作用により解 裂する基を有する重合単位を30~80モル%の範囲で 含有するのが好ましい。そして、酸の作用により解裂す る基として特に、式(1)で示される(メタ)アクリル 酸2-アルキル-2-アダマンチルの重合単位、好まし くはメタクリル酸2-エチル-2-アダマンチルの重合 単位は、樹脂全体のうち20モル%以上とするのが有利 10 である。もちろん、メタクリル酸2-エチル-2-アダ マンチルの重合単位を有する樹脂は、この単位ととも に、式(I)で示され、メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル以外のモノマーの重合単位を有することも できるが、この場合は、メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチルの重合単位を樹脂全体の20モル%以上と し、この単位を含めて式(1)で示される重合単位の合 計が樹脂全体のうち30~80モル%となるようにする のが好ましい。

【0030】式(II) で示される(メタ) アクリル酸3 20 -ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、式(III) で示される (メタ) アクリロニトリルの重合単位、式 (IV) で示される α-メタクリロイロキシ- y-プチロ ラクトンの重合単位、 及び式 (V) で示される無水マ レイン酸の重合単位は、樹脂中に合計20~70モル% の範囲で存在するのが好ましい。本発明において第一の 見地から特定する(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルの重合単位を有し、さらに (メタ) アクリ ル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位及び /又は(メタ)アクリロニトリルの重合単位を有する樹 30 脂の場合は、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位及び/又は(メタ)アクリロニ トリルの重合単位が合計で20モル%以上となるように するのが好ましく、任意にα-メタクリロイロキシ- y ブチロラクトンの重合単位及び/又は無水マレイン酸 の重合単位を導入する場合は、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位及び/又は (メタ) アクリロニトリルの重合単位と、α-メタクリ ロイロキシー v - プチロラクトンの重合単位及び/又は 無水マレイン酸の重合単位との合計が70モル%以下と 40 なるようにするのが好ましい。第一の見地及び第二の見 地から特定する樹脂はいずれも、本発明の効果を掴わな い範囲で、他の重合単位、例えば、遊離のカルボン酸基 を有する重合単位などを含有することもできる。

【0031】もう一つの成分である酸発生剤は、その物 質自体に、あるいはその物質を含むレジスト組成物に、 光や電子線などの放射線を作用させることにより、その 物質が分解して酸を発生するものである。酸発生剤から 発生する酸が前記樹脂に作用して、その樹脂中に存在す ような酸発生剤には、例えば、オニウム塩化合物、有機 ハロゲン化合物。スルホン化合物。スルホネート化合物 などが包含される。具体的には、次のような化合物を挙 げることができる。

【0032】ジフェニルヨードニウム トリフルオロメ タンスルホネート、4-メトキシフェニルフェニルヨー ドニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-メト キシフェニルフェニルヨードニウム トリフルオロメタ ンスルホネート、ビス(4 -tert-ブチルフェニル)ヨ ードニウム テトラフルオロボレート、ビス(4-tert ープチルフェニル) ヨードニウム ヘキサフルオロホス フェート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス(4-tert ープチルフェニル) ヨードニウム トリフルオロメタン スルホネート、

【0033】トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、トリフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、pートリルジフェニル スルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、p-トリルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタン スルホネート、2、4、6-トリメチルフェニルジフェ ニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、 4-tert-プチルフェニルジフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-フェニルチオフェ ニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェ ート、4-フェニルチオフェニルジフェニルスルホニウ ム ヘキサフルオロアンチモネート、1-(2-ナフト イルメチル) チオラニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、1-(2-ナフトイルメチル)チオラニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1 ーナフチルジメチルスルホニウム ヘキサフルオロアン チモネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルス ルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、 【0034】2-メチル-4、6-ビス(トリクロロメ

チル) -1、3、5ートリアジン、2、4、6ートリス (トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン、2-フェニルー4、6-ビス(トリクロロメチル)-1、3、 5ートリアジン、2-(4-クロロフェニル)-4,6 ービス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジ ン、2-(4-メトキシフェニル)-4,6-ビス(ト リクロロメチル)-1, 3,5-トリアジン、2-(4 ーメトキシー1ーナフチル)ー4,6ービス(トリクロ ロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(ベンゾ [d] [1, 3] ジオキソラン-5-イル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン、 る酸の作用で解裂する基を解裂させることになる。この so 2-(4-メトキシスチリル)-4,6-ビス(トリク

ロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 5-トリメトキシスチリル) -4.6-ビス(トリ クロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 4-ジメトキシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロ メチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジ メトキシスチリル) - 4、6-ビス(トリクロロメチ ル) -1、3、5-トリアジン、2-(2-メトキシス チリル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(4-プトキシスチリル)-4. 6-ピス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジ ン、2-(4-ペンチルオキシスチリル)-4,6-ビ ス(トリクロロメチル)-1.3.5-トリアジン、 【0035】1-ベンゾイル-1-フェニルメチル p ートルエンスルホネート(通称ベンゾイントシレー ト)、2ーベンゾイルー2ーヒドロキシー2ーフェニル エチル p-トルエンスルホネート (通称α-メチロー ルベンゾイントシレート)、1、2、3-ベンゼントリ イル トリスメタンスルホネート、2,6-ジニトロベ ンジル pートルエンスルホネート、2-ニトロベンジ ル nートルエンスルホネート、4-ニトロベンジル nートルエンスルホネート、

【0036】ジフェニル ジスルホン、ジーロートリル ジスルホン、ビス (フェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ピス(4-クロロフェニルスルホニル)ジアゾメタ ン、ビス (p-トリルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (4-tert-ブチルフェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(2,4-キシリルスルホニル)ジアゾメタ ン、ピス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、 (ベンゾイル) (フェニルスルホニル) ジアゾメタン、 【0037】N-(フェニルスルホニルオキシ)スクシ 30 ンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N- (トリフルオロメチルスルホ ニルオキシ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチル スルホニルオキシ) -5-ノルボルネン-2, 3-ジカ ルボキシイミド、N- (トリフルオロメチルスルホニル オキシ) ナフタルイミド、N-(10-カンファースル ホニルオキシ) ナフタルイミドなど。

【0038】また、一般に化学物館型のボジ型レジスト 組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性合窒素有 機化合物、例えばアミン類を、クェンチャーとして添加 することにより、露光後の引き置きに伴う酸の失活によ る性能労化を改良できることが知られており、大部門に おいても、このような塩基性化合物を配合するのが好ま しい。クェンチャーに用いられる塩基性化合物の具体的 な例としては、以下の各式で示されるようなものが挙げ られる。

[0039]

12

【0041】本契押のレジスト組成物は、その全圏形分 重量を基準に、機能を80~99.9重量%、そして酸発 生剤を0.1~20重量%の範囲で含有するのが穿ましい。また、クェンチャーとしての塩基性化合物を用いる場合は、同じくレジスト組成物の全圏形分重重を基準 に、0.0001~0.1重量%の範囲で含有するのが好ま しい。この組成物はまた、必要に応じて、増感剂、溶解 加止剤、他の側筋、界面活性剤、安定剤、集料など、各 種の添加物を単合すすることもできる。

【0042】 本発明のレジスト組成物は通常、上記の各成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液となり、シリコンウェハーなどの基株上に築布される。ここで用いる溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸発した後に均一で平滑な塗脱を与えるものであればよく、この分野で一般に用いられている溶剤が使用しらる。例えば、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート、スチルセコン・アナルンチン・メチル・フェーテル・アナモテートのであるなグリコールモーメチル・フェーテル・アナモートのようなグリコールエーテル・エステータの

ル類、ジエチレングリコールジメチルエーテルのような エーテル類、乳酸エチル、酢酸プチル、酢酸アミル及び ビルビン酸エチルのようなエステル類、アセトン、メチ ルイソブチルケトン、2 ~ ペブタノン及びシクロペキサ ノンのようなアトン類、 ~ プチロラクトシのような環 状エステル類などを挙げることができる。これらの溶剤 は、それぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いる ことができる。

【0043】基係上に集命され、乾燥されたレジスト照には、パターニングのための選光処理が施され、次いで 10 脱保護基反応を促進するための加熱処理を行った後、アルカリ現像被で現像される。ここで用いるアルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリを指数であることができるが、一般には、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや(2ーヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムヒドロキシド(適略コリン)の水溶液が用いられることが多い。

#### [0044]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 20 限定されるものではない。例中にある部は、特記ないか ぎり重量基準である。また重量平均分子量は、ポリスチ レンを観唱品として、ゲルバーミェーションクロマトグ ラフィーにより求めた値である。

【0045】モノマー合成例1 (メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチルの合成)

2 ーメチルー 2 ーアダマンタノール83.1gとトリエチルアミン101gを仕込み、200gのメチルインプチルケトンを加えて溶液とした。そこに、メタリル酸クロリド78.4g(2ーメチルー2ーアダマンタノールに 対して1.5モル倍)を滴下し、その後、室温で約10時間機準した。濾過後、有機層を5重量%重膜液ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて2回水洗を行った。有機層を濃縮した後、減圧蒸留して、次式で示されるメタクリル酸2ーメチルー2ーアダマンチルを収率75%で得た。「0046]

【0047】モノマー合成例2(メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチルの合成)

2 - アダマンタノン3 1.1g にジエチルエーテル5 0 g を加えて溶液とし、この溶液の温度が10でを越えない ように維持しながら、そこにエチルリチウムを1.14 モ ル/1 濃度で含むジエチルエーテル溶液200mを適下 した。そのままりでで2時間脱性した後、10でを越えないように維持しながら、メタクリル酸クロリド26.2 g(2ープダマンタノンに対して1.2年ル停)を消下した。消下終了後、室温で約12時間攪拌した。その後、析出した無機塩を適別し、有機罰を5重量を重量決酸ナトリウム水溶液(定計)に、続いて状況を2回行った。有機関を濃縮した後、減圧蒸留して、次式で示されるメタクリル酸2ーエチルー2ーアダマンチルを収率60%で得た。

[0048]

【0049】モノマー合成例3(α-メタクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの合成)

 $\alpha$  一プロモー  $\gamma$  ープ中ロラクトン 1 0 0 g と メタクリル 酸 1 0 4 .4 g ( $\alpha$  ープロモー  $\gamma$  ープチロラクトンに対し  $\tau$  2 .0 年ル信)を仕込み、 $\alpha$  ープロモー  $\gamma$  ープチロラクトンの 3 重観信のメチルイソブチルケトンを加まて溶液 とした。そこにトリエチルアミン 1 8 3 .6 g ( $\alpha$  ープロモー  $\gamma$  ープチロラクトンに対して 3 .0 モル信)を消下し、その後、室温で着り 1 の時間幾年した。濾道後、有機 層を 5 電影の 乗換機分ト 1 りのよ水溶液で洗浄し、続いて水洗を 2 回行った。有機層を機械して、次式で示される  $\alpha$  ーメタクリロイロキシー  $\gamma$  ープチロラクトンを収率 8 5 % で想か、

[0050]

#### 【0051】樹脂合成例1(樹脂Aの合成)

メタクリル酸2ーメチルー2ーアダマンチル、メタクリル酸3ードドロキシー1ーアダマンチル及び $\alpha$ ーメタクリロイロキシーyーブチロラクトンを5:2.5:2.5のモル比(20.0g:10.1g:7.8g)で仕込み、全モノマーの2乗量倍のメチルイソプチルケトンを加えて落線とした。そこに、開始制としてアゾビスイツブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加し、85℃で約8時間加熱した。その後、反応液を大量のヘブタンに注いで洗錠させる操作を3回行い、稍製した。その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が50:25:25:25、温度平均分手量が約4,500の共東合体を得た。これを機関名とする。

[0052]

$$\begin{array}{c|c} CH_{3} & CH_{3} \\ \hline CH_{2}C & CH_{2}C \\ C=O & CH_{3}C \\ CH_{3} & CH_{2}C \\ C=O & CH_{3}C \\ CH_{3} & CH_{3}C \\ C=O & C$$

### 【0053】樹脂合成例2(樹脂Bの合成)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、メタクリ 10 ロニトリル及び無水マレイン酸を5:2.5:2.5のモル 比(20.0g:3.1g:4.5g)で仕込み、全モノマー の2 重量倍のテトラヒドロフランを加えて溶液とした。

15

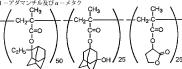
そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを 全モノマー量に対して2モル%添加し、60℃で約12 時間加熱した。その後、反応液を大量のヘプタンに注い で沈澱させる操作を3回行い、精製した。その結果、次 式で示され、各単位の組成モル比が50:25:25 で、重量平均分子量が約8.000の共重合体を得た。これ を樹脂Bとする。 [0054]

【0055】同様に、メタクリル酸2-メチル-2-ア ダマンチル、メタクリロニトリル及びα-メタクリロイ ロキシー y - プチロラクトンを共重合させることによっ て、それぞれの重合単位を有する三元共重合体が得られ Z.

# 【0056】樹脂合成例3(樹脂Cの合成)

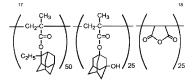
メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタクリ 30 【0057】 ル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル及びα-メタク

リロイロキシー v - ブチロラクトンを5:2.5:2.5の モル比 (20.0g: 9.5g: 7.3g) で仕込んだほか は、樹脂合成例1と同様に操作した。その結果、次式で 示され、各単位の組成モル比が50:25:25で、重 量平均分子量が約9.200の共重合体を得た。これを機能 Cとする。



【0058】樹脂合成例4(樹脂Dの合成) メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、 メタク リル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル及び無水マレ イン酸を5:2.5:2.5のモル比(20.0g:9.5g: 4.2g) で仕込んだほかは、樹脂合成例2と同様に操作 40 した。 その結果、次式で示され、各単位の組成モル比 が50:25:25で、重量平均分子量が約 17,000 の 共重合体を得た。これを樹脂Dとする。

[0059]



# 【0060】樹脂合成例5(樹脂Eの合成)

メタクリル酸 2 - エチル- 2 - アダマンチル、メタクリ 10 ロニトリル及び無木マレイン酸を5: 2.5: 2.50モル 比(20.0g: 2.9g: 4.2g) で仕込んだはかは、樹 脂合成例 2 と同様に操作した。その結果、次式で示さ

れ、各単位の組成モル比が50:25:25で、重量平 均分子量が約3,400の共電合体を得た。これを樹脂Eと する。 [0061]

## 【0062】樹脂合成例6(樹脂Fの合成)

メタクリル酸 2 ーエチルー 2 ーアダマンチル、メタクリ ロニトリル及び  $\alpha$  ーメタクリロイロキシー  $\gamma$  ープチロラ クトンを 5:2.5:2.5のモル比(20.0g:2.9g:7.3g)で仕込んだほかは、樹脂合成例 1 と同様に操作 した。 その結果、次式で示され、各単位の組成モル比 が50:25:25で、重量平均分子量が約 6,000の共 重合体を得た。これを樹脂 F とする。 【0063】

# 【0064】樹脂合成例7(樹脂Gの合成)

メタクリル酸2 - エチルー2- アダマンチル及びa - メタクリロイロキシーy - ブチロラクトンを5:5のモル比(40.0g:29.3g) で仕込んだほかは、樹脂合成例1と同様に兼作した。その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が50:50で、重量平均分子量が約5.600の共復合体を得た。これを側折しとする。

# 【0066】樹脂合成例8(樹脂Hの合成)

メタクリル機2 エチルー 2 一 アダマンチル、メタクリル機3 ード ドロキシー 1 一 アダマンチル及びメタクリロートリルを5:2.5:2.50の上化(20.0g;9.5 g:2.9g) で比込み、全モノマーの2 重量値のテトラ ヒドロフランを加えて溶液とした。そこに、開始剤とし でアゾピスインチロニトリルを全モノマー重に対して 2 モル%添加し、65℃で約12時間加熱した。その 後、反応液を大量のペプタンに注いで比膜させる操作を の組成モル比が50:25:25で、重量平均分子量 が約14,000の共重合体を得た。これを模脂日とする。 「100.671

#### 【0068】樹脂合成例9(樹脂1の合成)

メタクリル酸2ーエチルー2ーアダマンチル、メタクリ ル酸2ーメチルー2ーアダマンチル及びαーメタクロイ ロキシーyーブチロラクトンを2.5:2.5:5のモル比 (10.6g:10.0g:15.6g)で仕込み、全モノマ ーの2重融信のメチルインプチルケトンを加えて溶液と した。そこに、肌始創としてアゾピスインプチウェトリ ルを全モノマー能は対して2モルが添加し、85でで約 6時間加熱した。その後、反応液を大原のヘブタンに注 いで沈続させる操作を3回行い、精製した。 その結 果、次式で示され、各単位の組成モル比が25:25: 50で、重量平均分子が約9,000の共進合体を得た。 これを機断1とする。

#### 【0070】樹脂合成例10(樹脂」の合成)

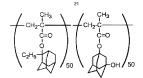
メタカリル酸2ーエチルー2ーアダマンチル、アクリル 酸3ーヒドロキシー1ーアダマンチル及び $\alpha$ ーメタカリ ロイロキシー $\gamma$ ーブチロラクトンを5:2.5:2.5のモ ル比(20.0g:8.9g:6.8g)で仕込み、全モノマ ーの2重要像のメチルインアチルケトンを加えて溶液と した。そこに、即始割としてアゾピスインプチロニトリ ルを全モノマー量に対して2モル%添加し、85でに昇 温して約5時間機弾した。反応マスを冷却した後、大量 のペプタンに注いで沈澱させる操作を3回行い、精製し た。その結果、次式で示され、各単位の組成モル比が5 0:25:25で、重量平均分子豊が約7,500の共重合 体を得た。これを機断」とする。

$$\begin{array}{c|c} \text{PELTTYEXAYYFIDEFU} & \text{OO71} \\ \text{CH}_{2} & \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} & \text{CH}_{2} & \text{CH}_{2} \\ \text{C}_{3} & \text{C}_{4} & \text{C}_{5} \\ \text{C}_{2} & \text{C}_{5} & \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} \text{C}_{5} & \text{C}_{5} & \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} & \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5} \\ \text{C}_{5}$$

# 【0072】樹脂合成例11(樹脂Kの合成)

メタカリル酸2ーエチルー2ーアダマンチル及びメタカリル酸3ーヒドロキシー1ーアダマンチルを5:5のモル比(20.0g:19·1g)で記合し、これらモノマーの合計と同様型の1、4ージオキサンを加えて溶液とし、そそに、開始納2とでアンピスインチョニトリルを全モノマー量に対して3モル%及び理額移動剤として3ーメルカプトプロピオン酸2ーエチルペキシルを全チノマー酸に対して5モル×添加し、この溶液を適下ロートに仕込んだ。別途、1、4ージオキサン50gを入れて70に保等。たフラスコに、上記のモノマー溶液を1、月間かけご常により容易を2年間向けて流下し、その後さら転り各間機性を続け

た。反応マスを冷却した後、大豊のヘブタンに注いで改 酸させる操作を3回行い、精乳した。その結果、次式で 示され、各単位の組成をル比が50:50で、重量平均 分子重が約3,500の共重合体を得た。これを樹脂Kとす る。 【0073】



【0074】樹脂合成例12(樹脂Xの合成:比較用) メタカリル種2-メチルー2-アダマンチル及びa-メ タクリロイロキシー $\gamma$ -ブチロラクトンを5:5のモル 比(15.0g:11.7g)で仕込んだほかは、樹脂合成 例1と同様に操作した。その結果、次式で示され、各単 位の組成モル比が50:50で、重量平均分子量が約10,000の共連合体を得た。これを樹脂Xとする。

【0076】実施例1及び2

樹脂D又は樹脂E(いずれも無水マレイン酸単位を含ん でいる)を10部、酸発生剤としてp-トリルジフェニ ルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート (み どり化学(株)製の"MDS-205")を0.2部、及びクェ ンチャーとして2,6-ジイソプロピルアニリンを0.0 30 15部用い、 これらを2-ヘプタノン45部に溶か し、さらに孔径0.2 μmのフッ素樹脂製フィルターで濾 過してレジスト液を調製した。ヘキサメチルジシラザン を用いて23℃で20秒間処理したシリコンウェハー (水の接触角50°) 又は、有機反射防止膜を塗布した シリコンウェハーに、上で調製したレジスト液を乾燥後 の膜厚が 0.5 µmとなるよう塗布した。有機反射防止膜 は、Brewer社製の "DUV-42" を、215℃、60秒のベ −ク条件で570Åの厚さとなるように塗布して形成さ せた。レジスト液塗布後のプリベークは、120°C、6 40 0秒の条件で、ダイレクトホットプレート上にて行っ た。

【0077】 こうしてレジスト膜を形成したウェハー に、KrFエキシマステッパー〔(株)ニコン製の"NSR 2205 EX12B"、NA-0.55、σ-0.8〕を用い、霧光量を段階

的に変化させてラインアンドスペースパターンを設光し た。ラインアンドスペースパターンの露光は、ダーケフ ィールドパターンのレチクル (マスク) とブライトフィ ールドパターンのレチクル(マスク)の2種類を用いて 行った。ここでいうダークフィールドパターンのレチク ルとは、レジストパターンのスペース部だけがガラス面 で、他の部分がすべてクロム面となっており、したがっ て露光現像後は、ラインアンドスペースパターンの周囲 がすべてレジスト層として残るパターンを与えるもので あり、またブライトフィールドパターンのレチクルと は、外枠がクロム面で、その枠の内側にガラス面をベー スとしてレジストパターンのライン部がクロム層でパタ ーン形成されており、したがって露光現像後は、ライン アンドスペースパターンの周囲のレジスト層が除去さ れ、さらにその外側に外枠相当のレジスト層が残るパタ ーンを与えるものである。露光後は、ホットプレート上 にて、表1に示す温度で60秒間ポストエキスポジャー ベーク (PEB) を行い、さらに、2.38重量%テトラ メチルアンチニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパ ドル現像を行った。現像後のパターンを走査型電子顕微 鏡で観察し、有機反射防止障基板上に設けたレジスト膵 から得られたパターンについて、以下の方法で、実効感 度及び解像度を調べた。

22

【0078】実効感度: ダークフィールドパターンの レチクルを用いた場合及びプライトフィールドパターン のレチクルを用いた場合について、0.3 μ=のラインア ンドスペースパターンが1:1となる露光量で表示し た。

【0079】解像度: ダークフィールドバターンのレ チクルを用いた場合及びプライトフィールドパターンの レチクルを用いた場合について、実効感度の露光量で分 離するラインアンドスペースパターンの最小寸法で表示 した。

【0080】また、有機反射防止膜を設けない基板上の パターンについて接着性の評価を行った。すなわち、有 機反射防止膜のない基板上に形成したレジア、関に対 し、現像した後のパターンを観察し、プライトフィール ドパターンの外幹部のレジア、がレチクルのでは おりに残って接着しているものを○、その外枠部のレジ ストが一部でも剥がれて欠けているものをとと表示し た。以上の結果を、用いた樹脂の細類とともに表1に示 す。

【0081】 【表1】

例 No. 樹脂 PEB 実効感度 解像度 接着性 (m1/cm²) (μm) ダーク プライト ダーク アライト

23

実施例1 D 120℃ 22 22 0.22 0.21 ○
" 2 E 100℃ 46 44 0.19 0.18 ○

[0082] 実施例3~8及び比較例1~2

表2に示す機能(これらは無水マレイン機単位を含まないものである)を10部用い、落剤をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート47.5部及びケープチロラクトン2.5部の語合常剤に変更した以外は実施例1及び2と同様にしてレジスト液を調製した。これらのレジスト液を用い、基本的は実施例1及び20千腕を繰り返すが、有機及射防止膜の形成は、実施例3、5及び6対形に対象が用については対象例1及び20千腕を繰り返すが、有機及射防止膜の形成は、実施例3、5及び6対形に分解的1については準備例1及び2日間接 Br

24

[0083]

【表2】

例 No		樹脂	反射防止膜	PEB	実効		解作		接着性
					(mJ/cm <sup>2</sup> )		(μm)		
					ダーク	プライト	ダーケ	プライト	
実施例	13	A	DUV-42	120℃	38	36	0.24	0.21	0
//	4	C	DUV-30-16	120℃	20	20	0.22	0.21	0
#	5	F	DUV-42	100℃	42	44	0.22	0.18	0
//	6	G	DUV-42	80°C	24	24	0.20	0.20	0
//	7	Н	DUV-30-16	120℃	32	30	0.21	0.19	0
//	8	I	DUV-30-16	110℃	22	22	0.22	0.21	0
比較例	J 1	Х	DUV-42	120℃	26	28	0.24	0.21	×
//	2	X	DUV-30-16	120℃	24	24	0.24	0.21	×

【0084】表1及び表2に示すとおり、本発明で規定 する樹脂を用いたレジストは、現像剥がれを起こすこと がなく、基板に対する接着性に優れている。また解像度 も良好であり、特にメタクリル酸2ーエチルー2ーアダ マンチルの単位を有する樹脂を用いた実施例1、2及び 4~8のレジストは、比較例に比べて解像度が改良され ている。本発明のレジストは、感度が大きく損なわれる こともなく、ドライエッチング耐性と良好である。 【0085】実施例9~11及び比較例3

[0.0.86] Brewer 社製の有機反射防止限用組成物で ある "DUV-30-16" を塗布し、215℃、60秒の条件 でベークして、厚さ 1,600 $\lambda$ 0の有機反射防止酸を形成さ せたシリコンヴェハーに、上で調製したレジスト液を乾 機後の限厚が0.39  $\mu$ mとなるようにスピンコートし た。レジスト液管布後は、ダイレクトホットプレート上 50 にて表3に示す温度で60移間プリペークした。こうしてレジスト膜を形成したウェハーに、A r F エキシマステッパー ((株)ニコン製の "%SB Ari" 、) 34-0.55、の=0.6) を用い、露光量を設備的に変化させてラインアンドスペースパターンを露光した。露光後は、ホットプレート上にて表った。写進度で60秒間ポストエキスポジャーペーク (PEB) を行い、さらに2.38 重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパドル現像を行った。現像後のブライトフィールドパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、以下の方法で実効感度を扱い作品を表しまった。

ベースパターンが1:1となる療光量で表示した。 【0088】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。 【0089】

[表3]

20

例 No	).	樹脂	プリベーク	PEB	実効感度 (mJ/cm²)	解像度 (µm)
実施	列 9	A	150℃	140℃	24	0.15
	10	С	130℃	130℃	21	0.15
п	11	J	130℃	115℃	25	0.15
比較	列3	x	130℃	130℃	32	0.16

【0090】表3からわかるように、本発明で規定する 樹脂を用いたレジストをArFエキシマレーザー露光に 適用した場合、比較例に比べて、感度及び解像度が改良 される。また、先の実施例  $1 \sim 8$  で用いた組成物も、ArFエキシマレーザー露光機による露光で、同様に優れた性能のレジストパターンを与える。

【0091】 (2発明の効果】 本発明の化学管幅型ボジ型レジスト組成 物は、基底への接着性に優れ、またドライエッチング耐 性や感度、解像度などのレジスト語低能も良好である。 したがって、この組成物は、KrFエキシマレーザーや ArFエキシマレーザーなどを用いた誤光に適してお り、それによって高い性能のレジストパターンを与え ス.